04;10 Эффект усиления эмиссии при генерации низкоэнергетического субмиллисекундного электронного пучка в диоде с сеточным плазменным катодом и открытой границей анодной плазмы

© С.В. Григорьев, В.Н. Девятков, Н.Н. Коваль, А.Д. Тересов

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск E-mail: grigoriev@opee.hcei.tsc.ru

Поступило в Редакцию 25 июня 2009 г.

Представлены результаты исследования эффекта усиления эмиссии электронов в плазмонаполненном диоде на основе плазменного катода с сеточной стабилизацией границы плазмы при ускоряющем напряжении до 20 kV. Суть явления состоит в том, что при увеличении рабочего давления $\ge 10^{-2}$ Ра и продольного магнитного поля ≥ 20 mT происходит существенное (в некоторых случаях в 2 и более раз) увеличение тока в ускоряющем промежутке. Экспериментально показано, что наиболее вероятным механизмом, ответственным за данное явление, является вторичная ионно-электронная эмиссия, возникающая с поверхности эмиссионного электрода, в результате ее бомбардировки ионами, поступающими из плазмы, генерируемой электронным пучком в пространстве дрейфа, и ускоренными в слое пространственного заряда между поверхностью эмиссионного электрода и открытой границей пучковой (анодной) плазмы.

В последние несколько лет для работ по модификации поверхности металлических и металлокерамических материалов интенсивно используются субмиллисекундные (до $200\,\mu$ s) и низкоэнергетические (до $20\,\text{keV}$) электронные пучки, генерируемые в электронном источнике с сетчатым плазменным катодом и открытой границей анодной плазмы [1,2]. Анодная плазма в таких источниках формируется самим пучком при прохождении им пространства дрейфа и ионизации рабочего газа. Авторами было обнаружено, что при увеличении рабочего давления $p \ge 10^{-2}$ Ра и при наложении продольного магнитного поля $B_z \ge 20\,\text{mT}$ в такой системе существенно (в некоторых случаях в 2

23

и более раз) увеличивается ток в ускоряющем промежутке, превосходя по абсолютной величине ток разряда, генерирующего плазму в электродной системе сетчатого плазменного катода. Известно, что в традиционных системах эффективность электронных источников с плазменным катодом определяется коэффициентом извлечения электронов из разрядной ячейки плазменного катода. Причем коэффициент извлечения α , равный отношению тока пучка I_b к току разряда I_d , для таких систем $\alpha = (I_b/I_d) \leq 1$. [3]. Если предположить, что весь ток в ускоряющем промежутке переносится электронами, эмитированными из катодной плазмы через ячейки эмиссионной сетки, то коэффициент извлечения α должен быть ≤ 1 и ток в ускоряющем промежутке не должен превышать ток основного разряда плазменного катода. Таким образом, в экспериментах был зарегистрирован "дополнительный" ток, величина которого была сравнима с величиной тока разряда, а в некоторых случаях превышала ее. Калориметрические измерения интегральной энергии пучка на коллекторе показали, что увеличение тока в ускоряющем промежутке сопровождается пропорциональным увеличением энергии. Было сделано предположение, что механизм увеличения эмиссии может быть связан с вторичной ионно-электронной эмиссией с поверхности эмиссионного электрода под действием ионов, генерируемых пучком в пространстве дрейфа и ускоренных в слое пространственного заряда между границей пучковой (анодной) плазмы и эмиссионным электродом до энергии, соответствующей приложенному ускоряющему напряжению. Для проверки данного предположения были выполенны эксперименты, которые позволили оценить вклад вторичной ионно-электронной эмиссии в ток электронного пучка.

На рис. 1 представлена схема электронного источника. Плазменный катод представляет собой газоразрядную систему с двухступенчатым дуговым разрядом низкого давления. Инициирующий (поджигающий) разряд загорается между полым электродом *1*, помещенным в поле постоянных магнитов, и катодом *2* при приложении импульса напряжения U_{trig} величиной 12–15 kV. Амплитуда тока поджигающего разряда $I_{trig} \sim 10-15$ A при длительности импульса 25 μ s. Основной дуговой разряд горит между катодом *2* и полым анодом *3*. Постоянное ускоряющее напряжение $U_{ac} \sim 15$ kV прикладывается между плоским эмиссионным электродом *5* и извлекающим электродом *6*, выполненным в виде диафрагмы с отверстием Ø 82 mm. Извлекающий электрод, труба дрейфа 7 и коллектор *8* находятся под потенциалом "земли". Эмиссионный электрод представляет собой диск Ø 82 mm (нержавеющая сталь) с



Рис. 1. Схема электронного источника.

эмиссионным отверстием Ø 40 mm в центре. Эмиссионное отверстие закрывалось мелкоструктурной сеткой из нержавеющей стали 4 с размером ячейки 0.3 × 0.3 mm и прозрачностью 50%. Извлечение электронов из плазмы под действием ускоряющего напряжения происходит с центральной части эмиссионного электрода через ячейки эмиссионной сетки. Граница катодной плазмы стабилизируется сеткой, а граница анодной плазмы, создаваемой электронным пучком в пространстве дрейфа, остается подвижной. Электроны пучка транспортируются к коллектору в магнитном поле двух катушек 9, величина поля в которых в представленных экспериментах составляла 30 mT. Длительность импульса тока пучка $\tau = 100\,\mu s$ задавалась длительностью импульса тока основного разряда. В качестве рабочего газа использовались аргон и гелий. Давление газа в рабочей камере варьировалось в диапазоне $0.5 \cdot 10^{-2} - 2.5 \cdot 10^{-1}$ Ра. Так как напуск газа осуществлялся в электронный источник, реальное давление области транспортировки электронного пучка было выше, причем в области эмиссионной сетки оно превышало измеренные значения (рабочее давление) в $\sim 4-5$ раз. В качестве датчиков тока использовались пояса Роговского. Ускоряющее напряжение измерялось с помощью резистивного делителя напряжения.

Первый эксперимент заключался в том, что отверстие диафрагмы в извлекающем электроде 6 (рис. 1) было уменьшено с \emptyset 82 до \emptyset 40 mm,

для того чтобы ионы из анодной плазмы, созданной пучком в трубе дрейфа, экранировались и не попадали на плоскую часть эмиссионного электрода. Для обратного ионного потока оставалась открытой только площадь эмиссионного отверстия, перекрытого сеткой. Амплитуда тока разряда составляла $I_d = 100$ A, ускоряющее напряжение $U_{ac} = 15$ kV, рабочее давление $p_{Ar} = 3 \cdot 10^{-2}$ Pa, внешнее аксиальное магнитное поле $B_z = 30$ mT. В результате при установке диафрагмы \emptyset 40 mm амплитуда тока в ускоряющем промежутке уменьшилась со 120 до 80 A. Наиболее вероятным представляется, что существенное усиление тока в отсутствие диафрагмы связано с увеличением обратного ионного тока и возникновением вторичного электронного тока с плоской части эмиссионного электрода.

Следующий эксперимент был выполнен с целью проверки влияния материала эмиссионного электрода на усиление эмиссии. Плоская часть эмиссионного электрода была изготовлена из трех материалов с различными коэффициентами вторичной ионно-электронной эмиссии: меди, нержавеющей стали и алюминия. В качестве рабочего газа использовались аргон и гелий. Сравнивался ток в ускоряющем промежутке при одинаковых заданных значениях тока разряда, рабочего давления, магнитного поля и ускоряющего напряжения. Результаты эксперимента показаны на рис. 2. Так же как и в предыдущем эксперименте, плоская часть эмиссионного электрода дает значительный вклад в увеличение тока в ускоряющем промежутке, причем видно, что для различных материалов величина этого вклада разная. Амплитуда тока в ускоряющем промежутке имеет наименьшее значение для меди, возрастает для нержавеющей стали и еще более возрастает для алюминия. Эти результаты качественно согласуются с литературными данными. В [4] представлены зависимости коэффициентов вторичной ионноэлектронной эмиссии от энергии ионов He⁺ для различных материалов мишени. По данным [4], коэффициенты вторичной ионно-электронной эмиссии при бомбардировке ионами He⁺ с энергией 15 keV составляют для Cu \sim 1.5, для Fe \sim 3 и для Al \sim 5.5.

Для количественной оценки вклада ионно-электронной эмиссии в увеличение тока и энергии электронного пучка были проведены калориметрические измерения интегральной энергии пучка на коллекторе и трубе дрейфа в зависимости от рабочего давления газа. Пучок транспортировался во внешнем аксиальном магнитном поле $B_z = 30$ mT. Измерения проводились при фиксированной амплитуде тока разряда



Рис. 2. Осциллограммы импульсов тока: тока разряда $I_d = 50 \text{ A}$ (1) и тока в ускоряющем промежутке I_g (2–4) для различных материалов плоской части эмиссионного электрода — меди (2), нержавеющей стали (3), алюминия (4). Ускоряющее напряжение $U_{ac} = 15 \text{ kV}$, магнитное поле $B_z = 30 \text{ mT}$. $a - p_{\text{Ar}} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ Pa}$, 100 A/div, $25 \mu \text{s/div}$; $b - p_{\text{He}} = 2.5 \cdot 10^{-1} \text{ Pa}$, 200 A/div, $25 \mu \text{s/div}$.



Рис. 3. a — энергия, рассчитанная по осциллограммам тока и напряжения в ускоряющем промежутке (1), суммарная интегральная энергия, измеренная на коллекторе и трубе дрейфа (2), энергия, измеренная на коллекторе (3), и уровень энергии при условии 100% извлечения электронов (энергия, рассчитанная по осциллограммам тока разряда и усоряющего напряжения) (4) в зависимости от давления в рабочей камере. b — общий ток в ускоряющем промежутке (1), ток полной эмиссии (2), ток разряда (3) и обратный ионный ток (4) в зависимости от давления в рабочей камере. $I_d = 100$ A, $U_{ac} = 15$ kV, $B_z = 30$ mT.

 $I_d = 100$ А. Ток разряда, ток в ускоряющем промежутке и ускоряющее напряжение регистрировались с помощью цифрового осциллографа одновременно с калориметрическими измерениями в каждом импульсе. Измерения показали, что во внешнем магнитном поле $B_z = 30$ mT электронный пучок практически полностью транспортируется к коллектору и токовые потери на трубу дрейфа составляют не более 5%. На рис. 3, *а* представлены зависимости энергии, рассчитанной по осциллограммам ускоряющего напряжения и тока в ускоряющем промежутке, и суммарной энергии, измеренной калориметрами на коллекторе и трубе дрейфа, от давления (кривые 1 и 2). Кривая 4 показывает уровень значений



интегральной энергии пучка при условии 100% извлечения электронов из катодной плазмы (энергия, рассчитанная по осциллограммам тока разряда и ускоряющего напряжения). Видно, что с увеличением давления суммарная измеренная энергия плавно растет и начиная с $p\sim 3\cdot 10^{-2}$ Ра измеренные значения интегральной энергии пучка превышают расчетные значения при условии 100% извлечения электронов из катодной плазмы. Предполагая наличие ионно-электронной эмиссии с поверхности эмиссионного электрода, регистрируемый общий ток в ускоряющем промежутке I_g можно представить как сумму токов

$$I_g = I_e + I_i + \gamma I_i, \tag{1}$$

где I_e — ток электронов, эмитированных из плазменного катода; I_i — обратный ток ионов из пространства трубы дрейфа на эмиссионный электрод; γ — эффективный коэффициент ионно-электронной эмиссии материала эмиссионного электрода. Энергия, рассчитанная по осцилло-

граммам тока и напряжения в ускоряющем промежутке, имеет вид

$$E_{c} = \int_{0}^{\tau} I_{g}(t) U_{ac}(t) dt = \int_{0}^{\tau} [I_{e} + I_{i} + \gamma I_{i}] U_{ac} dt, \qquad (2)$$

где τ — длительность импульса тока пучка. Суммарная интегральная энергия, измеренная калориметрами на коллекторе и трубе дрейфа, не включает в себя ионную компоненту:

$$E_{b} = \int_{0}^{\tau} I_{b}(t) U_{ac}(t) dt = \int_{0}^{\tau} [I_{e} + \gamma I_{i}] U_{ac} dt.$$
(3)

Энергию, привносимую низкоэнергетичными плазменными электронами и ионами на коллектор и трубу дрейфа, считаем пренебрежимо малой. Таким образом, из (2) и (3) можно оценить средний за импульс ионный ток в ускоряющем промежутке:

$$I_i = (E_c - E_b)/(U_{ac}\tau).$$
 (4)

С увеличением рабочего давления увеличивается разница значений энергии между кривыми 1 и 2 (рис. 3, а). Это свидетельствует об увеличении обратного ионного тока в ускоряющем промежутке с ростом давления. Например, для точки, соответствующей рабочему давлению $p = 3.2 \cdot 10^{-2}$ Ра, средняя амплитуда ионного тока, оцененная по (4), составляет I_i = 44 A. В то же время в области минимальных давлений $p \leq 10^{-2}$ Ра значения стремятся к точке, где соотношение энергии, рассчитанной по осциллограммам тока и напряжения в ускоряющем промежутке, и энергии, измеренной калориметрами, практически совпадает (доверительные интервалы измерений пересекаются), т.е. грубо можно считать, что обратный ионный ток на эмиссионный электрод отсутствует и общий ток в ускоряющем промежутке определяется током электронов, эмитированных плазменным катодом. В условиях эксперимента эта точка соответствует давлению $p \sim 0.8 \cdot 10^{-2}$ Ра. Ток электронов по амплитуде равен ~ 55 А, и коэффицицент извлечения электронов из плазменного катода можно оценить как 0.55 (рис. 3, b). Зная ток электронов, извлеченных из катодной плазмы, и обратный ионный ток на эмиссионный электрод, можно оценить эффективный

коэффициент γ . Для нержавеющей стали, бомбардируемой ионами аргона с энергией 15 keV, по результатам экспериментов он составил $\gamma \sim 1.5$. На рис. 3, *b* показаны зависимости измеренных тока разряда и общего тока в ускоряющем промежутке, а также рассчитанных по вышеописанной методике обратного ионного тока и тока полной эмиссии электронов в зависимости от рабочего давления.

Полученные экспериментальные данные и оценки позволяют предложить следующий механизм, объясняющий эффект усиления эмиссии в диоде с плазменным катодом и открытой границей анодной плазмы. Импульсный электронный пучок, генерируемый в газонаполненном диоде и транспортируемый в трубе дрейфа, помещенной в аксиальное магнитное поле, создает интенсивную плазму. Ионы, образующиеся в пространстве дрейфа и ускоренные, в слое пространственного заряда между границей пучковой (анодной) плазмы и эмиссионным электродом до энергии, соответствующей приложенному ускоряющему напряжению $(15 \sim 20 \, \text{keV})$, попадают на металлическую поверхность эмиссионного электрода и выбивают вторичные электроны, которые также ускоряются. Таким образом, ток пучка ускоренных электронов представляет собой сумму тока электронов, извлеченных из газоразрядной плазмы, генерируемой дуговым разрядом в электродной системе плазменного катода и тока вторичной ионно-электронной эмиссии с металлической поверхности эмиссионного электрода. Этот эффект не только следует учитывать при проведении экспериментов, но и можно целенаправленно использовать для повышения эффективности плазменных источников электронов.

Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ 08-08-92207 ГФЕН_а и 09-02-90456 Укр_ф_а, грантом программы президиума РАН № 30 и интеграционными проектами СО РАН № 34, 42.

Список литературы

- [1] Коваль Н.Н., Щанин П.М., Девятков В.Н. и др. // ПТЭ. 2005. В. 1. С. 135.
- [2] Ivanov Yu.F., Kolubaeva Yu.A., Teresov A.D. et al. // Proc. 9th Int. Conf. Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows. Tomsk, Russia, 2008. P. 143.
- [3] Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов. М.: Атомиздат, 1977. 144 с.
- [4] Кикоин И.К. Таблицы физических величин. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.